**SHOWA/SGC-22SA-IAD多層膜真空蒸鍍裝置使用辦法**

用途:金屬氧化物薄膜、光學薄膜鍍膜、抗反射鍍膜、透明導電薄膜鍍膜、介電質薄膜鍍膜..等。

廠牌與型號:SHOWA/SGC-22SA-IAD

腔體尺寸:Φ900mm\*H1125mm

膜厚控制:石英膜厚監控系統與光學監控系統

雙電子槍

掛具:傘式，批量鍍膜:10~15片4吋(~8片6吋)silicon wafer/次

加熱源:電子槍與電阻式

排氣系統:DP，RP，MP

靶材: SiO2、Ti3O5、Al2O3、Ta2O5、SiO等氧化物(介電質)

* 注意事項
1. 本系統每週開放服務5天，每週六、日預設為設備維護保養時間。
2. 所有使用者均需經過認證，且每次使用前均需完成線上登記方可使用。
3. 預約後欲取消須於24小時之前至線上，違者當天停止使用並照常計費。
4. 其他相關規定與罰責，依據奈米中心儀器管理辦法實施。
5. 若須進行委託製程，則需額外支付操作服務費，為避免不必要紛爭，委託製程不保證實驗良率。
6. 嚴禁將易揮發之樣品放進腔體中，以免造成汙染，違者停權，並需負擔後續維修費用。
7. 氧氣流量需固定在0.5L/min，不得隨意更改，如有異常請聯絡儀器管理者。
8. 不論是自行操作或委託製程，在實驗前需與儀器負責人溝通，若有特殊需求(如委託合作進行製程開發)，請與奈米中心與儀器負責人聯絡。
* 開放時間：

每週星期一至星期五9:00-21:00 國定假日及周末不開放

* 收費標準：

使用費：本校3000元/次(run)(不含靶材)，外校4000元/次(不含靶材)，業界5500元/次(不含靶材)。每一次實驗不超過2小時。超過時間1500元/小時。

委託操作服務費：使用費+本校1000元/次，外校1000元/次，業界1000元/次

* 課程與認證收費標準：

課程費：本校2000元，外校3600元，業界6000元

認證費：本校1500元，外校1800元，業界3000元

* 靶材收費(可向本校奈米中心購買，目前中心有SiO2與Ti3O5)

SiO2 1400 元/KÅ

Ti3O5 1500 元/100Å

鎢舟 100元/次

鉬舟 500元/個

鉬坩鍋 2,500元/個

自備靶材 鍍率超過70Å/min, 200 元/KÅ

 70Å-50Å/min, 400 元/KÅ

 49Å-40Å/min, 800 元/KÅ

 39Å-30Å/min, 1400 元/KÅ

 29Å-20Å/min, 1800 元/KÅ

 19Å-10Å/min, 2200 元/KÅ

 10Å-5Å/min, 3000 元/KÅ

 4Å-1Å/min, 500 元/100Å

開放自行使用（使用者需經過操作認證）